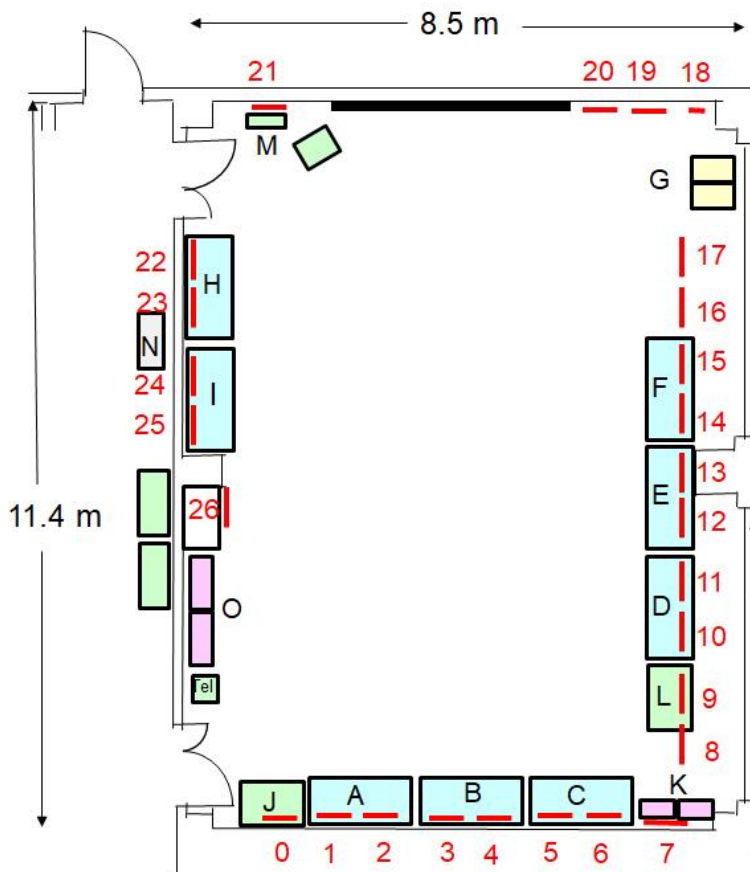
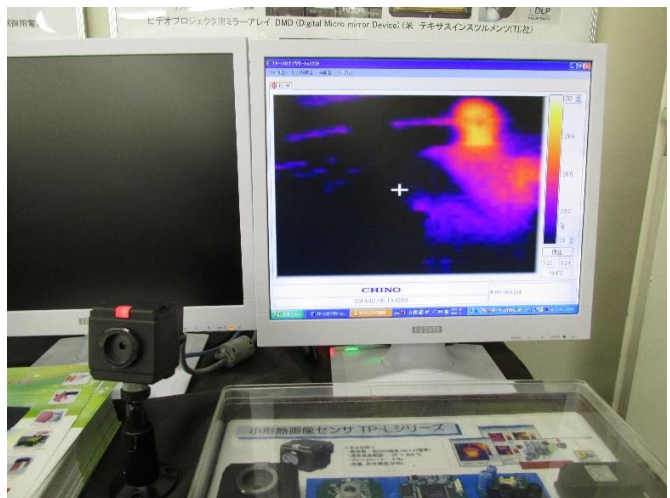


仙台 MEMS ショールーム

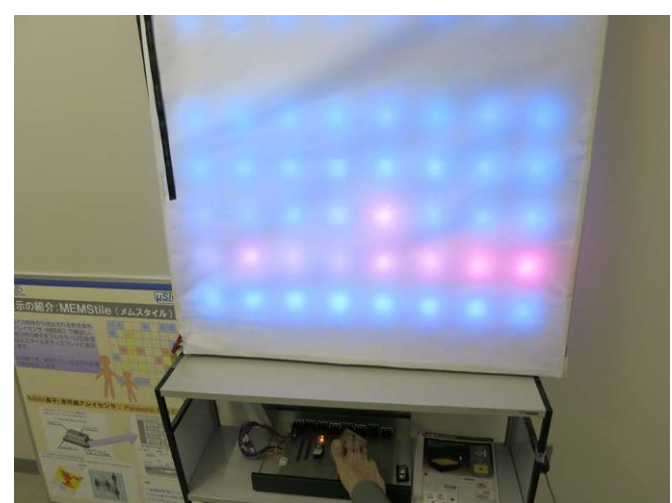


- 机 J : 赤外線イメージャ、光スキャナ利用距離画像センサ
- ケース A : DMD とインクジェットプリンタ、画像と光 MEMS
- ケース B : 圧・加速度センサ、ジャイロ
- ケース C : RF MEMS、ナノマシンング
- 棚 K : CMOSLSI の設計・試作
- 机 L : 半導体イオンセンサ(ISFET)
- ケース D : 医用マイクロセンサ、マイクロ流体
- ケース E : ヘテロ集積化 (MEMS on LSI)
- ケース F : 耐環境デバイス、Power MEMS
- ケース G : フラウンホーファ研究機構
- 机 M : iCAN (MEMS 応用コンテスト)
- ケース H : MEMS PC と μ SIC によるオープンコラボレーション
- 机 N : 赤外線センサアレイ
- ケース I : IMEC
- 棚 O : 受賞

- ポスター 0 : MEMS とは
- ポスター 1 : 光 MEMS とマイクロ/ナノ光学
- ポスター 2 : MEMS 用 PZT 薄膜
- ポスター 3 : RF MEMS
- ポスター 4 : 機械量センサ
- ポスター 5 : マイクロマシンングとパッケージング
- ポスター 6 : ナノマシンング
- ポスター 7 : CMOS LSI の設計・試作
- ポスター 8 : センサネットワーク
- ポスター 9 : 医用マイクロセンサ(ISFET 他)
- ポスター 10 : 低侵襲医療とヘルスケア
- ポスター 11 : 触覚センサネットワーク
- ポスター 12 : LSI 上への MEMS の転写によるヘテロ集積化
- ポスター 13 : 超並列電子ビーム描画装置の開発
- ポスター 14 : Power MEMS
- ポスター 15 : 製造・検査・環境・安全関係 MEMS
- ポスター 16 : アドバンテスト
- ポスター 17 : リコー
- ポスター 18 : U.C.Berkeley
- ポスター 19 : フラウンホーファ研究機構
- ポスター 20 : 東北大学のフラウンホーファプロジェクトセンタ
- ポスター 21 : iCAN (MEMS 応用コンテスト)
- ポスター 22 : MEMS パークコンソーシアム
- ポスター 23 : μ SIC によるオープンコラボレーション
- ポスター 24 : IMEC (SiGe MEMS の拠点)
- ポスター 25 : IMEC (エネルギーハーベスタ用 MEMS と電子嗅覚)
- ポスター 26 : 東北大学と企業の連携による MEMS 製品化の例



表彰（庄子征希、森山雅昭、戸津健太郎、本間孝治(ムスア)）距離画像センサ(日本信号)と赤外線イメージャ(Chino)



2017年度「電気の礎」として顕彰された ISFET

8×8 赤外線センサアレイ（パナソニック）